(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-311936 (P2000-311936A)

(43)公開日 平成12年11月7日(2000.11.7)

(51) Int.Cl.		識別記号	FΙ		Ŧ	-マコード(<u>参考</u>)
HOIL	21/68		H01L	21/68	v	3 E 0 6 7
B65D			B65D	81/20	E	3 E O 9 6
	85/86			85/38	R	5 F O 3 1

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

(21)出願番号	特願平11-118387	(71) 出願人	000228925		
			三菱マテリアルシリコン株式会社		
(22)出願日	平成11年4月26日(1999.4.26)		東京都千代田区大手町一丁目5番1号		
	•	(72)発明者	遠藤 光弘		
	;		東京都千代田区大手町1丁目5番1号 三		
			菱マテリアルシリコン株式会社内		
		(74)代理人	100094215		
	•		弁理士 安倍 逸郎		

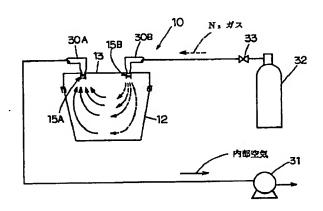
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ウェーハ収納方法やよびこれに用いられるウェーハケース

(57)【要約】

【課題】 密閉空間を用いず、ガス使用量も少なく、短時間でごみ侵入を防ぎ、不活性ガスをケースに充填する。不活性ガスの置換終了時を的確に検出する。ケースのごみ濾過性を高める。ケース内外圧力差を短時間で解除する。

【解決手段】 ウェーハケース内を不活性ガスでパージする場合、第1フィルタに吸出ノズルを、第2フィルタにガス供給ノズルを接続する。第1フィルタを通して微細ごみ類を濾過しながら空気を吸い出し、第2フィルタで不活性ガス中の微細ごみ類を濾過しながらケース内へ不活性ガスを供給する。この結果、ウェーハケース内へのごみ類の侵入を防止しながら、短時間で不活性ガスに置換できる。ケースを外部から隔離するための真空容器が不要で、ガス使用量も少なくなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウェーハが収納されて、容器本体および /またはこれを密閉する蓋の外壁に、ケース内外を連通 する第1のフィルタと第2のフィルタとを互いに離間し て配設されたウェーハケースを準備し、

上記第1のフィルタに上記ウェーハケースの内部空気の 吸い出しノズルを接続する一方、上記第2のフィルタに 不活性ガスの供給ノズルを接続し、

その後、上記第1のフィルタを通して、上記吸い出しノ ズルから上記ウェーハケースの内部空気を吸い出すとと 10 もに、上記第2のフィルタを通して、上記供給ノズルか ら上記ウェーハケース内へ不活性ガスを供給すること で、上記ウェーハケースの内部空気を不活性ガスに置換 するウェーハ収納方法。

【請求項2】 上記ウェーハケースの内部空気と不活性 ガスとの置換は、上記第1のフィルタを通過した内部空 気の酸素濃度が10% mol/リットル以下になった ときに終了する請求項1に記載のウェーハ収納方法。

【請求項3】 ウェーハが収納される容器本体を蓋を用 いて密封するウェーハケースにおいて、

上記容器本体および/または上記蓋の外壁に、上記ウェ ーハケース内外を連通する第1のフィルタと第2のフィ ルタとを互いに離間して配設したウェーハケース。

[請求項4] 上記第1のフィルタおよび第2のフィル タは、上記容器本体および/または蓋の外壁の対角位置 に配設されている請求項3に記載のウェーハケース。

【請求項5】 上記第1のフィルタおよび/または第2 のフィルタは、0.05μm以上の大きさの微細などみ 類を99. 9%以上濾過することができる請求項3また は請求項4に記載のウェーハケース。

【請求項6】 ウェーハケースの容積をVリットルとし たとき、上記フィルタは、V/1500 (mol/分) 以上の値で気体の流出入を許容する請求項3~請求項5 のうちのいずれか1項に記載のウェーハケース。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明はシリコンウェーハ などをケースに収納するウェーハ収納方法およびこれに 用いられるウェーハケース、詳しくはごみ類のケース内 への侵入を防ぎながら不活性ガスをこのケース内に充填 40 するためのウェーハ収納方法およびこれに用いられるフ ィルタ付きのウェーハケースに関する。

[0002]

【従来の技術】ウェーハ製造工場で作製されたシリコン ウェーハなどの半導体ウェーハは、輸送中における損傷 や汚染などを防止するために、通常、クリーンルームの 中で、ガスケット(バッキング材)によって蓋が密封さ れたウェーハケースに収納されている。なお、このクリ ーンルームの室内は、一般的に、ごみやほこりがフィル タリングされた湿度50%前後、室温(20℃前後)の 50 としている。また、この発明は、ウェーハケースの内部

空気で満たされている。ところで、どんなに高水準のク リーンルームであっても、この室内には、微量ながら、 細かいごみやほこりが浮遊しているのが現状である。 【0003】したがって、このクリーンルーム内でウェ ーハケースを密封すると、このケース内にクリーンルー ムの微細などみ類が侵入するおそれがある。このどみ類 には、有機物が含まれている場合も多い。さらに、殊 に、輸送中に外気温度が低下した場合など、ウェーハケ ースに密封されたクリーンルーム内の空気に含まれてい る湿気が結路となり、この結路がシリコンウェーハの表 面にできると、とのウェーハ表面に均一に分布していた Na、Zn、Caなどの微小な異物が水滴の張力で引き 寄せられて局部集中し、これが微小粒子の異常成長を招 くおそれもあった。しかも、その結果、結路が解消して も、この異物が残されて、ウェーハの鏡面に局部的にく もりが発生し、シリコンウェーハの品質が低下するとい

【0004】これらの問題点を解消する従来技術とし て、例えばウェーハケース内に N 2 ガスなどの不活性ガ 20 スを充填して、この結露等を防止するウェーハ収納方法 が知られている。この従来方法は、まず真空容器内に、 容器本体内にウェーハが密封された蓋付きのウェーハケ ースを配置し、真空ポンプにより容器内を減圧してケー ス内の空気を抜き取る。その後、この容器内にN2ガス などの不活性ガスを供給することで、この不活性ガスが ウェーハケース内に充填されるというものである。

[0005]

う問題点があった。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな従来技術のウェーハ収納方法では、通常、この真空 容器の内部が汚れているために、不活性ガスをウェーハ ケース内に充填する際、真空容器内に存在する微細など み類がケース内に侵入するおそれがあった。この結果、 収納されたシリコンウェーハの表面に、どみ類が付着し て、この面が汚染されるという問題点があった。また、 一連の不活性ガスの充填作業時には、いったん、真空容 器内を減圧したり、不活性ガスにより満たすようにしな ければ、ウェーハケース内を減圧し、または、不活性ガ スを充填することができない。この結果、真空容器と、 この容器内を減圧する大型の負圧装置とが必要となって 設備コストが嵩む一方、との充填作業に時間がかかって 作業性が悪くなり、さらに不活性ガスの使用量も増大す るという問題点があった。

[0006]

【発明の目的】この発明は、ウェーハケースを外部より 遮断する真空容器などの密閉空間を用いず、かつ不活性 ガスの使用量も少なく、さらに比較的短時間で、しかも **ごみ類の侵入を防ぎながら、この不活性ガスをケース内** に充填することができるウェーハ収納方法およびこれに 用いられるウェーハケースを提供することを、その目的 空気と不活性ガスとの置換終了時を的確に検出すること ができるウェーハ収納方法を提供することを、その目的 としている。さらに、この発明は、ウェーハケースの略 全ての内部空気を不活性ガスと置換することができるウ ェーハケースを提供することを、その目的としている。 また、この発明は、ごみの濾過性が高いウェーハケース を提供することを、その目的としている。さらに、この 発明は、ケース内外に生じた圧力差を比較的短時間で解 除でき、これによりウェーハケースの内部空気を不活性 ガスでパージする時間を短縮できるウェーハケースを提 10 供することを、その目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の発明 は、ウェーハが収納されて、容器本体および/またはと れを密閉する蓋の外壁に、ケース内外を連通する第1の フィルタと第2のフィルタとを互いに離間して配設され たウェーハケースを準備し、上記第1のフィルタに上記 ウェーハケースの内部空気の吸い出しノズルを接続する 一方、上記第2のフィルタに不活性ガスの供給ノズルを 接続し、その後、上記第1のフィルタを通して、上記吸 20 い出しノズルから上記ウェーハケースの内部空気を吸い 出すとともに、上記第2のフィルタを通して、上記供給 ノズルから上記ウェーハケース内へ不活性ガスを供給す ることで、上記ウェーハケースの内部空気と不活性ガス とを置換するウェーハ収納方法である。

[0008]容器本体および蓋の素材としては、例えば ポリカーボネート (PC), ポリエチレン (PE), ポ リプロピレン (PP)、ポリスチレン (PS)、PEE K、ポリブチルテレフタレート (PBT) などの各種の プラスチックや、硬質アルミニウム、ステンレスなどの 30 スである。 金属でもよい。容器本体と蓋との間には、通常、閉蓋時 にケース内の密封性を高めるためにガスケットが介在さ れている。また、このウェーハケースの密封性の度合い は、ウェーハの航空輸送の場合、航空機が高度数千~1 万mを飛行して、その際の機内貨物室の気圧が0.7~ 0.8atmに達することから、フィルタの圧力損失以 上の耐圧が得られるように設計した方が好ましい。

[0009]第1, 第2のフィルタの素材としては、例 えばニトロセルロース、セルロースアセテート、四フッ 化エチレン樹脂(PTFE)、親水性四フッ化エチレン 40 樹脂などの各種合成樹脂からなるメンブランフィルタな ど、周知のフィルタが採用することができる。両フィル タの平均孔径は、大気中に浮遊するごみなどをフィルタ リングすることができる大きさであれば限定されない。 また、これらのフィルタの外形寸法も、フィルタがケー ス内外の圧力差に耐えられる寸法であれば、限定されな い。さらに、両フィルタの取り付け位置は、容器本体、 蓋のどの部分でもよい。また、容器本体と蓋との両方に 取り付けてもよい。さらに、第1のフィルタおよび第2

1個ずつでも、2個以上の複数個ずつでも、異なる個数 どうしを組み合わせたものでもよい。

[0010]各フィルタに接続される吸い出しノズルや 供給ノズルは、ケース内の空気を排出したり、このケー ス内へ不活性ガスを供給したりできれば、どのような材 質(可撓性の有無を含む),大きさ、形状のものでもよ い。また、第1または第2のフィルタが複数個ある場合 は、同じ種類のフィルタに、それぞれ対応するノズルを 個別に取り付けてもよいし、または例えばフード状の大 口ノズルを使用して、同じ種類の各フィルタを外部から ―括して覆うようにしてもよい。ウェーハケースの内部 空気と置換可能な不活性ガスとしては、例えばN』ガ ス、Arガスなどが挙げられる。なお、これらの事項は 請求項3にも該当する。

【0011】請求項2に記載の発明は、上記ウェーハケ ースの内部空気と不活性ガスとの置換は、上記第1のフ ィルタを通過した内部空気の酸素濃度が10~5 mol /リットル以下になったときに終了する請求項1に記載 のウェーハ収納方法である。内部空気の酸素濃度を測定 するのは、第1のフィルタを通過後の内部空気吸い出し 系の任意箇所でよい。酸素濃度の検出基準値は10-5 mol/リットルである。また、検出基準値が10- ® mol/リットル未満では時間がかかり過ぎるという不 都合が生じる。

【0012】請求項3に記載の発明は、ウェーハが収納 される容器本体を蓋を用いて密封するウェーハケースに おいて、上記容器本体および/または上記蓋の外壁に、 上記ウェーハケース内外を連通する第1のフィルタと第 2のフィルタとを互いに離間して配設したウェーハケー

【0013】請求項4に記載の発明は、上記第1のフィ ルタおよび第2のフィルタは、上記容器本体および/ま たは蓋の外壁の対角位置に配設されている請求項3に記 載のウェーハケースである。容器本体および/または蓋 の外壁の対角位置とは、容器本体の対角位置、蓋の外壁 の対角位置、または、容器本体と蓋の外壁との対角位置 のどこでもよい。

【0014】請求項5に記載の発明は、上記第1のフィ ルタおよび/または第2のフィルタは、0.05 μm以 上の大きさの微細などみ類を99.9%以上濾過すると とができる請求項3または請求項4に記載のウェーハケ ースである。とのフィルタは、パーティクルカウンタで 0. 05μm以上のごみやほこりを検出するときに、そ の99.9%を濾過可能な性能を有する。フィルタが、 0.05μm未満のほとりを濾過することができるもの とすれば、常圧に戻るために要する時間が長くなる。な お、0.05μm以上の大きさの微細などみ類を99. 9%以上濾過することができるフィルタは、第1のフィ ルタだけでもよいし、または第2のフィルタだけでもよ のフィルタの各個数は限定されない。例えば、それぞれ 50 く、さらには第1,第2のフィルタの両方であってもよ 20

61

【0015】請求項6に記載の発明は、ウェーハケース の容積をVとしたとき、上記フィルタは、V/1500 (mol/分)以上の値で気体の流出入を許容する請求 項3~請求項5の内、いずれか1項に記載のウェーハケ ースである。フィルタによる気体濾過の速度が、V/1 500 (mol/分) 未満とすると、ケース内外の差圧 をなくすための時間が長くなり過ぎ、ウェーハケースの 内部空気を不活性ガスにパージする時間が長くなる。な お、この場合のフィルタの個数は上述のように任意であ 10 り、複数個のフィルタの場合、全体として上記条件を満 たすこととなる。

[0016]

[作用] この発明によれば、ウェーハが収納されたウェ ーハケース内の空気を不活性ガスにバージする場合に は、まず容器本体および/またはこれを密閉する蓋の外 壁に配設された第1フィルタに吸い出しノズルを接続す るとともに、第2のフィルタに不活性ガスの供給ノズル を接続する。次いで、第1のフィルタを通して、内部空 気の微細などみ類を濾過しながら、吸い出しノズルより ケース内空気を吸い出すとともに、第2のフィルタによ り、不活性ガス中の微細などみ類を濾過しながら、供給 ノズルよりウェーハケース内へ不活性ガスを供給する。 この結果、ウェーハケースの内部空気と不活性ガスと が、外気中に浮遊するどみ類の侵入を防止しながら、短 時間のうちに効率良く置換される。この際、従来手段の 場合に使用していたウェーハケースを外部から遮断する ための、例えば真空容器などが不要となるので、設備コ ストが大幅に低減される。しかも、不活性ガスの使用重 も少なくなる。その後、ウェーハケースは、この不活性 30 ガスが充填されたままで、通常は、例えばアルミフィル ム袋やラミネート袋で梱包された後、各種の輸送機関に よりデバイス工場などに出荷される。

【0017】特に、請求項2の発明によれば、第1のフ ィルタを通過した内部空気の酸素濃度が10⁻⁵mol /リットル以下になったら、不活性ガスによるパージが 終了したものとみなして、ウェーハケースの内部空気と 不活性ガスとの置換を終了する。これにより、ウェーハ ケースの内部空気と不活性ガスとの置換終了時を的確に 検出することができる。

[0018]また、請求項4の発明によれば、第1,第 2のフィルタが容器本体および/または蓋の外壁に対角 配置されているので、ウェーハケース内で、ケース外へ 吸い出される内部空気と、ケース内へ供給される不活性 ガスとの対流が生じ、これによって略全ての内部空気を ケース内に滞留させることなく良好に外部へ排出すると ともに、ケース内を不活性ガスで充満させることができ

【0019】さらに、請求項5の発明によれば、フィル タとして、 $0.\,\,0.5\,\mu\,\mathrm{m}$ 以上のごみやほこりを $9.9.\,\,9.\,\,50$ い密閉性でもって閉蓋される。そして、蓋 $1.3\,\mathrm{o}$ 上壁の

%以上濾過することができるものを採用したため、不活 性ガスをケース内に充填する際に、密閉空間内のかなり 微細などみまでフィルタリングすることができる。

【0020】さらにまた、請求項6に記載の発明では、 フィルタによる気体の流出入の速度をV/1500(m o 1/分) としているので、比較的短時間で、ケース内 外の圧力差を解除することができる。

[0021]

[発明の実施の形態]以下、この発明の実施例に係るウ ェーハ収納方法およびこれに用いられるウェーハケース を説明する。図1はこの発明の一実施例に係るウェーハ 収納方法の説明図である。図2はこの発明の一実施例に 係るウェーハケースの全体斜視図である。図3はこの発 明の一実施例に係るウェーハケースの正面図である。図 4は同平面図である。図5は同閉蓋中における図2のA - A拡大断面図である。図6(a)は容器本体と蓋との 接合部の構造を示す部分拡大断面図である。図6(b) はガスケットの圧縮変形を説明するための略図である。 図7はフィルタユニットの拡大斜視図である。図8はフ ィルタユニットの使用状態の拡大断面図である。

【0022】図2~図4に示すように、10はこの発明 の一実施例に係るウェーハケースである。このウェーハ ケース10は、例えば8インチのシリコンウェーハ11 が収納される四角形で箱形の容器本体12と、この容器 本体12の上面にある開口部を閉蓋する蓋13と、これ らの容器本体12や蓋13の開口周縁部の外壁間に介在 されたバッキング材の一例である環状ゴム製のガスケッ ト14と、蓋13の上壁の対角位置の内面に装着され て、ケース内外を連通する第1, 第2のフィルタユニッ ト15A, 15Bとを備えた内容量約15000ccの 密閉式のケースである。蓋13は、閉蓋時の上方側が凹 となった四角形の浅い皿状に成形されている。

[0023] 容器本体12および蓋13の素材として は、透明もしくは半透明のポリプロピレン(PP)およ びポリカーボネート (PC) が使用される。ガスケット 14は断面矩形の環状のゴム製である。容器本体12や 蓋13の鍔状の開口周縁部間に介在されて、ウェーハケ ース10の密閉性を確保するパッキング材としての役目 を果たす。具体的には、図6(a),(b)に示すよう に、このガスケット14は、容器本体12の開口周縁部 40 に周設された矩形断面のシール溝30に、若干その頭部 を突出させて収納されている。ガスケット14の内.外 周部 (非圧縮部) には、その全周にわたって凹部34が 形成されている。したがって、ガスケット14の非圧縮 面とシール溝30の壁部との間には間隙35が形成され ることとなる。

【0024】また、蓋13は、ガスケット14を介し て、容器本体 1 2 の開口部に、航空輸送時のケース内外 の圧力差が0.2気圧になったときもこれに耐え得る高 表面には、透明な上壁を通して覗き見えるウェーハ11 の枚数が、その枚数分の厚さ位置に合わせて表示されて いる。また、蓋13の上壁の対角部には、図8に示すよ うに、それぞれ容器内へ先細り状に突出する一対のボス 形状をした孔部13aが形成されている。各孔部13a にはケース内外を連通する通気孔が形成されている。と れらの孔部13aには、第1,第2のフィルタユニット 15のハウジング16の元部16 aが外嵌されている。 【0025】一方、図6に示すように、容器本体12の シール溝30の下面と、蓋13の周縁部に形成されたシ 10 ール溝32の上面とには、ガスケット14の上面および 下面にそれぞれ当接する一対のリブ31、33が周設さ れている。したがって、閉蓋時には、ガスケット14の 上部および下部がリブ31、33によって押し潰される (図6(a)参照)。しかしながら、ガスケット14の 非圧縮面とシール溝30の側壁との間に形成された間隙 35が、潰されて膨出したガスケット14の逃げ部とな る(図6(b)参照)。この結果、圧縮力を受けたガス ケット14は、シール滞30の側壁に妨げられることな く、スムーズに変形する。よって、蓋13の閉蓋操作が 20 容易になるとともに、接合部におけるシール機能の信頼 性が向上する。このような閉蓋構造により、蓋13は容 器本体12の開口部に、ケース内外の圧力差0.2気圧 に耐え得る高い密閉性で閉蓋される。

【0026】との閉蓋時において、蓋13を手動(自動 でも可)で容器本体12に圧着させる治具が、図2およ び図5に示す容器本体12の側板上部間に対向状態で配 設された一対のフック・レバー部400ある。以下、と れを説明する。図2、図5に示すように、フック・レバ 一部40は、ともに板材であるフック部材41とレバー 30 部材42とにより構成されている。フック部材41の上 部には係合孔41aが穿設されていて、下部にレバー部 材42の連結軸42aが軸支される切欠部が形成されて いる。このレバー部材42の元部両側には、容器本体1 2の側板上部から突出するリブ間に軸支された一対の取 り付け軸42bが突出している。なお、蓋13の開口周 縁部には、各係合孔41aと対向する箇所に、閉蓋時 に、この係合孔41aと接合する係合突起13dが突出 している。

[0027] したがって、閉蓋時には、容器本体12の 開口部上に蓋13を載置し、その後、各係合孔41aを それぞれの対応する係合突起13 dに係合させる。次 に、レバー部材 4 2 を取り付け軸 4 2 b を中心に垂直面 内で下方へ回動する。この結果、フック部材41は連結 軸42aを中心に垂直面内で回動させられながら押し下 げられる。これにより、蓋13が堅固に閉蓋される。な お、開蓋時には、この操作とは反対の操作を行う。

【0028】図7、図8に示すように、第1、第2のフ ィルタユニット15A、15Bは、軸線方向の長さが

1.5cmほどの小型のユニットである。この第1,第 50

2のフィルタユニット15A, 15Bは、ハウジング1 6と、その内部に収納された第1,第2のフィルタ17 A. 17Bとにより構成されている。ハウジング16 は、ポリプロピレン製の略コマ形状をした小型管体であ り、上記筒状の元部16aの先端側に、第1,第2のフ ィルタ17A、17Bの収納部を有する円盤状の濾過部 16 bと、若干小径な円筒状の先部16 cとが順次連結 されている。なお、この先部16cをカットして、第 1. 第2のフィルタユニット15A, 15Bの軸線方向 の長さをより短くしてもよい。第1, 第2のフィルタ1 7A. 17Bとしては、直径13mm、平均孔径0.5 μm (気体の場合0.05μm程度の粒子を濾過可 能)、有効濾過面積 O. 9 c m² 耐圧強度(2 5 °C時) 5. 3kgf/cm² (5. 3×10 Pa)、耐熱温 度60℃の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製のメン ブランフィルタが採用されている。

[0029]次に、この一実施例に係るウェーハケース 10を用いたウェーハ収納方法を説明する。図2~図4 に示すように、ケースパーツの洗浄後に組み立てられ、 さらに第1, 第2のフィルタユニット15A, 15Bが 組み込まれたウェーハケース10は、クリーンルーム内 で本体容器 12内に所定枚数のウェーハ11が収納され た後、フック・レバー部40を用いて、ガスケット14 を挟んで蓋13を閉蓋することにより、ウェーハ11が 良好に密封される。その後、図1に示すように、第1の フィルタ17Aを内蔵した第1のフィルタユニット15 Aに、ウェーハケース10の内部空気を吸い出す吸い出 しノズル30Aを接続する。吸い出しノズル30Aは、 真空ポンプ31にホース連結されている。一方、第2の フィルタ17日を内蔵した第2のフィルタユニット15 Bに、N2 ガスボンベ32にホース連結された供給ノズ ル30Bを接続する(図8も参照)。

【0030】次に、真空ポンプ31を作動させる。これ により、ウェーハケース10の内部空気は、この空気中 に含まれる微細などみ類が第1のフィルタ17Aにより 滤過されながら、吸い出しノズル30Aから外部へと吸 い出される。この結果、ウェーハケース10内は負圧化 する。この減圧と同時、または、ウェーハケース10内 が所定値まで減圧後、N2 ガスボンベ32のバルブ33 を開く。これにより、N2 ガスが供給ノズル30Bを通 過してケース10内に供給される。なお、N2ガス中の 微細などみやほこりは、第2のフィルタユニット15B を通過する際に濾過される。このようにしてケース内の 空気をNaガスに置換するので、従来手段のように、ウ ェーハケース10を密閉する空間を形成するための真空 容器が不要となる。この結果、設備コストを大幅に低減 できる。しかも、N2 ガスが充填されるのは、このウェ ーハケース10内だけとなるので、N2 ガスの使用重も 減少する。

【0031】さらには、従来手段のように、前もって真

空容器の内部空気をN。ガスに置換しなくてもよいので、両フィルタ17A、17Bによって外気中またはN。ガス中に存在する微細などみ類をフィルタリングしながら、ウェーハケース10の内部空気とN。ガスとを、短時間のうちに効率良く置換することができる。また、この一実施例では、第1、第2のフィルタ17A、17Bを、蓋13の対向する角部に対角配置したので、ウェーハケース10において、ケース外へ吸い出される内部空気と、ケース内へ供給される不活性ガス(N。ガス)との対流が発生する。これにより、略全ての内部空気を10滞留させることなく良好にケース外へ排出し、かつこのケース内を不活性ガスで充分に満たすことができる。

【0032】なお、この内部空気とN。ガスとのパージ中、常時、図示しない酸素濃度検出装置によって、吸い出しノズル30Aを通過中の内部空気の酸素濃度を検出する。そして、酸素濃度が10-5 mol/リットル以下になった場合には、このパージを終了する。このようにパージ作業を制御したので、ウェーハケース10の内部空気とN。ガスとの置換終了の時点を的確に検出することができる。その後、ウェーハケース10はN。ガス 20を充填したままで、図外のナイロン(ポリアミド繊維の商品名)またはポリエチレン製の内袋と、アルミニウムフィルム製の外袋19とにより二重にラッピングされた後、各種の輸送機関を利用して、ユーザー側のデバイス工場などへ出荷される。

【0033】とのように、ウェーハケース10に第1、第2のフィルタ17A、17Bを内蔵する第1、第2のフィルタユニット15A、15Bを取り付けたので、外気中を浮遊するごみやほとりがケース内に侵入するのを防ぎながら、とのケース内にN。ガスを充填することができる。ウェーハケース10内の空気がN。ガスに置換されることで、有機物を含む微細なごみ類のウェーハ付着を原因としたウェーハ表面の汚染が解消されたり、ケース内の湿気を原因としたウェーハ表面の微小粒子を防いたり、またデバイス工場で、この微小粒子などを除去するHF洗浄が省けるなどの効果が得られる。また、蓋13に第1、第2のフィルタユニット15A、15Bを組み付けただけなので、比較的低コストで前述した効果が得られる。

【0034】さらに、第1、第2のフィルタ17A、17Bが、0.05μm以上のごみやほこりを99.9%以上濾過することができるほど細かいので、ケース内にN2ガスを供給する際に、N2ガス中の微細なごみ類をフィルタリングすることができるとともに、バージ終了後、例えばウェーハ輸送時などの際において、外気中のかなり微細なごみやほこりまで除去することができる。さらにまた、第1、第2のフィルタ17による気体の濾過速度をV/1500(mol/分)としたので、第1、第2のフィルタユニット15を介して、最大1時間

くらいでケース内外の圧力を等しくすることができる。 この結果、ウェーハケース 1 0 内に N 2 ガスを充填する 作業時間を短縮することができる。

[0035]

【発明の効果】この発明によれば、ウェーハケースの内 部空気を不活性ガスにパージする場合には、第1,第2 のフィルタ、および、各フィルタに接続された吸い出 し、供給ノズルを介して、このケース内の空気と不活性 ガスとの置換を行うようにしたので、短時間のうちに効 率良く、外気中に浮遊するごみ類の侵入を防止しなが ら、不活性ガスをウェーハケースに充填することができ る。この際、従来手段で使用されていたウェーハケース を外部から遮断する、例えば真空容器などを不要とする ことができる。この結果、設備コストが大幅に低減され て、不活性ガスの使用量も減少させることができる。 [0036]特に、請求項2の発明によれば、第1のフ ィルタを通過した内部空気の酸素濃度が10~5 mol **/リットル以下になったら、ウェーハケースの内部空気** と不活性ガスとの置換を終了するようにしたので、ウェ ーハケースの内部空気と不活性ガスとの置換終了時を的

[0037] また、請求項4の発明によれば、第1,第2のフィルタを容器本体および/または蓋の外壁に対角配置したので、このウェーハケース内で、内部空気と不活性ガスとの対流が起き、これにより両気体間の置換がさらに良好となる。

[0038]特に、請求項5に記載の発明では、フィルタとして、0.05μm以上のごみやほとりを99.9%以上過過することができる目の細かいものを採用したので、不活性ガスをケース内に充填する際に、密閉空間内のかなり微細なごみまで濾過することができる。

【0039】また、請求項6に記載の発明では、フィルタとして、ウェーハケースの容積をVとしたとき、V/1500(mol/分)以上の値で気体の流出入を許容するものを採用したので、比較的短時間で、ケース内外の圧力差を解除することができる。この結果、ウェーハケース内に不活性ガスを充填する作業時間を短縮することができる。

【図面の簡単な説明】

確に検出することができる。

40 【図1】この発明の一実施例に係るウェーハ収納方法の 説明図である。

【図2】 この発明の一実施例に係るウェーハケースの全体斜視図である。

【図3】 この発明の一実施例に係るウェーハケースの正 面図である。

【図4】 この発明の一実施例に係るウェーハケースの平面図である。

【図5】との発明の一実施例に係るウェーハケースでの 閉蓋中における図2のA-A拡大断面図である。

) 【図6】(a)は容器本体と蓋との接合部の構造を示す

部分拡大断面図である。(b)はガスケットの圧縮変形 を説明するための略図である。

【図7】フィルタユニットの拡大斜視図である。

【図8】フィルタユニットの使用状態の拡大断面図であ る。

【符号の説明】

- 10 ウェーハケース、
- 11 ウェーハ、
- 12 容器本体、

*13 蓋、

15A 第1のフィルタユニット、

15日 第2のフィルタユニット、

16 ハウジング、

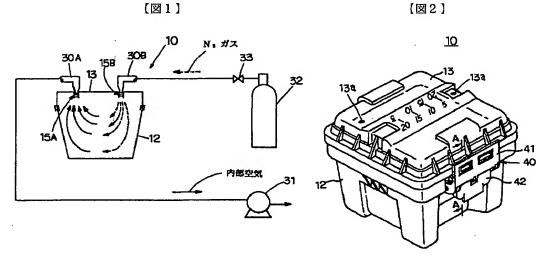
17A 第1のフィルタ、

17日 第2のフィルタ、

30A 吸い出しノズル、

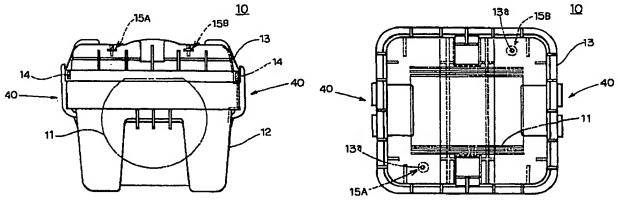
30B 供給ノズル。

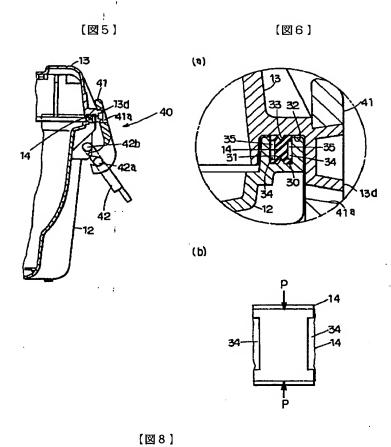


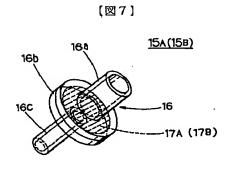


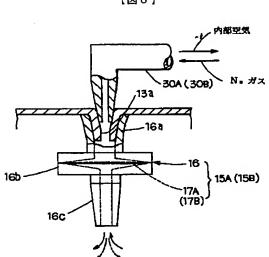
[図3]

【図4】









フロントページの続き

F ターム (参考) 3E067 AA13 AB99 AC04 AC11 BA05A BB14A GA19
3E096 AA06 BA16 BB04 CA02 CB03 DA30 DC02 EA02Y EA04X FA03 FA29 GA07
5F031 DA08 EA01 EA02 EA11 EA14 NA04 NA14 NA20